# Materialwissenschaftliche Aspekte der Leistungselektronik

# Integrierte 3D-Spulen mit Pulvermaterialkernen für miniaturisierte DC-DC-Wandler

T. Lisec, 08.05.17

# Einleitung

- Smart Power Einer der Top 4 Techniktrends weltweit. 0
- Einer der Hauptinhalte Spannungsversorgung moderner elektronischer Systeme. Ο
- Probleme: 0
  - Funktionelle Einheiten eines elektronischen Systems (z.B. Mobiltelefon) • erfordern unterschiedliche Versorgungsspannungen.
  - Spannungsversorgung muss dynamisch an jeweilige Erfordernisse angepasst werden können, um Energie zu sparen.
- Lösung: Individuell angepasste Spannungsversorgung für jede Funktionseinheit. Ο
- Spannungsversorgung Ο sollte daher:
  - keinen Platz einnehmen, •
  - nichts kosten, •
  - keine Energie verbrauchen.
- Miniaturisierung ist zwingend erforderlich.

Fläche (mm²)	Volumen (mm <sup>3</sup> )	Frequenz (MHz)
50	150	1
30	25	5
7	3,5	20
2	1	50-100

Evolution der Spannungsversorgung elektronischer Systeme [1].

### Seite 2



- Produkte sind als "System-in-Package" (SiP) erhältlich.
  - Bei den kleinsten Modulen ist der IC integriert im Träger, passive Elemente (Induktivitäten, Kondensatoren) befinden sich darüber auf dem Träger.
  - Kantenlänge der Module 2-12 mm je nach Funktionalität und Schaltfrequenz.



NXE1-Serie von Murata [4], Schaltfrequenz 75-120 kHz, 12.7 mm x 10.4 mm x 4.4 mm.



TPS81256 von TI [2], Schaltfrequenz 4 MHz.



Enpirion-Serie von Intel-Altera [3], EP5348UI: Schaltfrequenz 9 MHz, 2.0 mm x 1.75 mm x 0.9 mm.

- Weitere Verringerung der Baugröße nur durch Integration der passiven Elemente. Ο
  - $\rightarrow$  Sogenannte "System-on-Chip" (SoC) befinden sich weltweit in Entwicklung.
- Generelles Problem: Miniaturisierung der Induktivität. 0

### Seite 3

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



- Planare Spulen sind auf Halbleitersubstraten leicht zu erzeugen.
  - Standard sind Luftspulen  $\rightarrow$  Induktivität/Fläche per se sehr klein.
  - Leitbahnquerschnitt gering  $\rightarrow$  Widerstand hoch  $\rightarrow$  Windungszahl beschränkt.
- Luftspulen finden Anwendung im Bereich hoher Frequenzen und geringer Leistungen.



*iCoupler-Technologie von Analog Devices [5].* 

- Für DC-DC-Wandler sind Spulen mit Kern unumgänglich, um die erforderlichen hohen Induktivitätswerte zu erreichen.
- Probleme der Halbleitertechnologie:
  - Mittels der Standardverfahren lassen sich nur vergleichsweise dünne, metallische Schichten gut abscheiden.
  - Hohe Verluste durch Wirbelströme in metallischen Schichten.
  - Abscheidung von Ferrit-Schichten sehr aufwendig.

### Seite 4

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



# Stand der Technik integrierte Spulen mit Kern

Trotz Wirbelstromproblem basiert eine überwiegende Anzahl der integrierten 0 Lösungen auf Spulen mit metallischem Kern.



Integrierte Spule von Intel. Der Kern besteht aus mehreren dünnen, voneinander isolierten CoZrTa-Lagen [6].



Integrierte Spule von Tyndall. Der Kern besteht aus galvanischem NiFe. Ein DC-DC-Konverter mit bis zu 80% Effizienz im Bereich 20-40 MHz wurde demonstriert. 40% der Verluste werden durch Wirbelströme verursacht [7].



Frste Produkte sind vermutlich von 0 Ferric zu erwarten. Einführung wurde für 2018 annonciert.

Solenoid-Spulen von Ferric, integriert in BEOL-Prozess von TSMC [8].

#### Seite 5

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



# Stand der Technik integrierte Spulen mit Kern

- Alternativ zur dünnen Schichten werden Kerne unter Verwendung von polymer- $\mathbf{O}$ gebundenem Pulver hergestellt, z. B. durch Molding, Casting, Screen Printing u.Ä.
  - Das magnetische Material kann nahezu frei gewählt werden.
  - Erheblich geringere Wirbelstromverluste in metallischen Kernen, da die einzelnen Partikel elektrisch voneinander isoliert sind.



Planarspule, umhüllt von einem Carbonyleisen-Epoxy-Kern. Die Induktivität ist ca. 3 mal höher im Vergeich zu einer Luftspule gleicher Größe [9].



3D-Solenoid-Spule mit MnZn-Ferrit-BCB-Kern, eingebettet in ein Si-Substrat [10].



- Probleme: 0
  - Nachbearbeitung der Substrate stark eingeschränkt aufgrund der geringen thermischen und chemischen Beständigkeit des organischen Matrixmaterials.
  - Strukturen kleiner 100 µm lassen sich kaum noch erzeugen.

### Seite 6



### **Neue ISIT-Technologie**

- Ein am ISIT entwickeltes neues Verfahren erlaubt es, loses Pulver mittels Atomlagen-Abscheidung bei Temperaturen ≤ 300°C zu porösen 3D-Strukturen zu verfestigen.
  - Keine organischen Materialien involviert Weiterbearbeitung bei Temperaturen bis 400°C unter Verwendung von Standardprozessen der IC-Technologie möglich.
  - Es können Strukturbreiten weit unterhalb 100 µm realisiert werden.



- Ausgangsmaterialien:
  - Trägersubstrat mit Kavitäten.
  - Loses Pulver (Partikel).
- Einbringen der losen Partikel in die Kavitäten auf dem Substrat.
- Agglomeration der Partikel zu dreidimensionalen, porösen Körpern mittels Atomlagenabscheidung.

### Seite 7

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



- In einem Fraunhofer-internen Projekt des ISIT mit dem IZM wurde das neue technologische Verfahren auf weichmagnetische Materialien angewandt.
- Aus Fe- und NiFe-Pulver wurden ringförmige Teststrukturen mit einem porösen magnetischen Körper in eine Wanne aus Si hergestellt.
- Teststrukturen wurden am IZM auf ihre magnetischen Eigenschaften untersucht.



Foto von Teststrukturen aus 1 µm Carbonyl-Eisen-Partikeln, Querschnitts-Zeichnung sowie REM-Aufnahme einer fertiggestellten Teststruktur von oben. Der Außendurchmesser beträgt 6 mm.







Fotos des Messgeräts und der Probenaufnahme sowie Beschreibung des Prinzips.

#### Seite 8

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



- Je kleiner die Partikel desto langsamer fällt die 0 Permeabilität mit der Frequenz ab und desto geringer sind die Verluste (tan  $\delta$ ).
- Permeabilität sinkt mit steigender Porosität, 0
- Im unteren MHz-Bereich sind die Messungen 0 durch Proben- oder Meßaufbau verfälscht.



Änderung der Permeabilität in Abhängigkeit von der Porosität. Die Punkte entsprechen Messwerten für verschiedene Ferrite [11].

Partikel	Porosität	Porosität,
1 µm Fe	64%	ermittelt
10 µm Fe	56%	Gewichts-
44 µm NiFe	59%	messunger
44 µm Fe	70%	



Permeabilität und tan δ für unterschiedliche Proben.

#### Seite 9

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



© Fraunhofer ISIT 2016

Vertraulich

- Besonders hohe Porosität der Struktur aus 44 μm Fe kommt durch die komplexe, verästelte Form der Partikel zustande, die aus vielen kleinen Körnchen bestehen.
- Geringe Unterschiede in der Permeabilität von 1 µm und 10 µm Fe erklären sich durch die Partikelgröße, die sich kaum unterscheidet.



REM-Aufnahmen poröser Strukturen aus unterschiedlichen Partikeln, alle aufgenommen mit 500-facher Vergrößerung.



#### Seite 10

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



- Durch Bewickeln der Teststrukturen mit Cu-Draht (0,10 mm und 0,19 mm Ø) wurden Spulen hergestellt.
- $\circ$  Ergebnisse bei 2 mA<sub>AC</sub> und 20 mA<sub>AC</sub> sind identisch.
- Verluste bei 100 mA<sub>AC</sub>: 30 mW bei 10 MHz (ca. 3 Ω) bzw.
  300 mW bei 100 MHz (ca. 30 Ω).
- Otimaler Arbeitsbereich zwischen 10 und 30 MHz unabhängig vom Draht-Durchmesser.





Aufnahme der am IZM hergestellten Spulen (oben) sowie Foto des Messaufbaus (unten).



Induktivität, Widerstand und tan  $\delta$  für Spulen mit bzw. ohne magnetischen Kern im Bereich 100kHz-100 MHz (jeweils 15 Windungen bzw. 0.19 mm Cu-Draht).

### Seite 11

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



- Die Meßergebnisse lassen vermuten, daß: 0
  - die magnetischen Verluste mit der Frequenz kaum zunehmen und im • Vergleich zu den Wicklungsverlusten vernachlässigt werden können,
  - der optimale Arbeitsbereich vor allem von der Wicklungsausführung • bestimmt wird,
  - bis 200 mA<sub>AC</sub> kein nennenswerter Verlustzuwachs im  $R_s$  zu erwarten ist • und bis mindestens 2 A keine Sättigung für DC eintritt,
  - die Gleichstrommagnetisierung kaum Einfluss auf die Induktivität hat • und eine Vormagnetisierung bis zu 1 A problemlos möglich wäre.
- Ausgehend von den Ergebnissen lassen sich für die Leistungsübertragung eines 0 DC-DC-Wandlers folgende Grenzen annehmen:
  - im nichtkontinuierlichen Betrieb bei 10 MHz bis zu 10 Watt.
  - im kontinuierlichen Betrieb bei 100 MHz bis zu 5 Watt. •
- Es wurde ein Schaltungspatent für einen neuartige, ultraschnelle und rippelfreie Konverter-Topologie eingereicht, die ohne Glättungskondensatoren auskommt.
  - Bei 10 MHz mit Induktivitäten größer 400 nH erfolgreich simuliert. •

### Seite 12



# Integrierte 3D-Spule mit Kern

- Integrierte Spule muss mit konventionellen 0 Komponenten konkurrieren können.
- Zu den kleinsten konventionellen Spulen 0 gehört die PFL1005-Serie von Coilcraft.
  - Komposit-Kern, ۲
  - 18-1000 nH auf nur 0,73 mm<sup>2</sup> Fläche, •
  - Preis 0,36 ct. (ab 2000 Stück). •



### Coilcraft PFL1005-181MRU [12].



- 3D-Spule mit porösem Kern unter Nutzung einer TSV-Ο Technologie:
  - 50-150 µm Via-Durchmesser, 100-250 µm Pitch,
  - Dicke der Cu-Leitbahnen 20 µm,
  - Dicke des weichmagnetischen Kerns 300-600 µm. ٠
- Herstellungskosten für 200mm-Wafer im Entwicklungsstadium geschätzt 2500 Euro Ο
  - $\rightarrow$  10 ct./mm<sup>2</sup> (5 mm Randausschluss, 90 % Ausbeute).
- Angenommen, die Waferkosten sinken in großen Stückzahlen auf 800-1000 Euro Ο
  - $\rightarrow$  3-4 ct/mm<sup>2</sup>

### Seite 13



### Integrierte 3D-Spule mit Kern

 3D-Spulen von Silex ohne Kern erreichen bei 8 Windungen ca. 12 nH bei einer Fläche von ca.  $2 \text{ mm}^2$ .

Draufsicht auf eine 3D-Spule mit 8 Windungen (links) sowie 3D-Röntgen-CT einer Struktur mit 6 Windungen (rechts), beide von Silex. [13].



- Angenommen, die Miniaturspulen von Coilcraft kosten in sehr großen Stückzahlen 0 nur noch 8 ct./Stück.
- Integrierte Spule bleibt vergleichbar, wenn die Chipfläche 2 mm<sup>2</sup> nicht übersteigt. Ο
- Die Induktivität einer Spule, ähnlich zu der von Silex, wäre dann: 0
  - ca. 24 nH mit porösem Kern so wie jetzt ( $\mu_r = 2$ ), •
  - ca. 120 nH bei einer Steigerung der Permeabilität des porösen Kerns um • den Faktor 5 ( $\mu_r = 10$ ).
- Rein kostentechnisch betrachtet könnten integrierte Spulen für eine praktische 0 Anwendung in DC-DC-Wandlern attraktiv werden, sobald deren Schaltfrequenz einige 10 MHz erreicht.



### Seite 14

- Weitere Vorteile der integrierten 3D-Spule:
  - Maximale Stromdichte in planaren Leitbahnen auf Silizium ist sehr viel • größer, als in einem herkömmlichen Cu-Draht. Gemäß ITRS-Roadmap  $2 \times 10^{6}$  A/cm<sup>2</sup> bei 105°C.  $\rightarrow$  Theoretisch einige 10 A möglich in 10 µm dicken Cu-Leitbahnen
  - Platzersparnis durch die Möglichkeit der Integration der Spule direkt auf ۲ dem DC-DC-Wandler-IC oder einem Interposer-Chip.
- Wesentlicher Nachteil der integrierten 3D-Spule:  $R_{DC}$  ist vergleichsweise hoch, 0 Werte unter 0,5  $\Omega$  sind schon eine Herausforderung.
- Generell ist zu vermuten, dass bei gleichem Kernmaterial und vergleichbaren 0 Kernabmessungen mit integrierten Spulen eine ähnliche Performance erreicht wird wie mit herkömmlichen Bauteilen (z.B. aus der Coilcraft-Serie PFL1005).



All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.

# Fazit

- Eine kostengünstige Herstellung integrierter 3D-Spulen auf Siliziumsubstraten ist 0 möglich.
- Kann die Permeabilität des porösen Kernmaterials erheblich gesteigert werden, 0 könnten integrierte Spulen als Einzelbauteile im Bereich < 250 nH konkurrenzfähig werden zu herkömmlichen Miniaturspulen für Massenanwendungen wie DC-DC-Wandler
- Die Durchsetzung integrierter 3D-Spulen auf dem Markt ist vermutlich nur eine 0 Frage der Zeit.

#### Seite 16

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for property rights.



## Literatur

- C. O'Mathuna, "PwrSiP power supply in package power system in package", Proc. 3D-PEIM [1] 2016, Raleigh, NC, USA
- http://www.electronics-sourcing.com/2012/07/18/ti-introduces-ultra-small-boost-power-[2] module-for-smartphones-and-tablets/
- https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en\_US/pdfs/literature/br/enpirion-[3] brochure.pdf
- http://www.murata.com/en-us/about/newsroom/news/product/power/2014/1110 [4]
- [5] http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/digital-isolation-solutions-to-designproblems.html
- D. S. Gardner, "Review of on-chip inductor structures with magnetic films", Transactions on [6] Magnetics, Vol. 45, No. 10, 2009
- N. Wang, "High frequency DC-DC converter with co-packaged planar inductor and power [7] IC", Proc. ECTC 2103, Las Vegas, NV, USA
- N. Sturcken, "Integrated power conversion with thin-film magnetic core inductors", [8] Presentation APEC 2014, 3D Power packaging industry session, Beijing, China
- Y. Sugawa, "Carbonyl-iron/epoxy composite magnetic core for planar power inductor used [9]
- package-level power grid", Transactions on Magnetics, Vol. 49, No. 7, 2013 in
- [10] X. Fang, "A novel silicon-embedded toroidal power inductor with magnetic core", *Electron* Dev. Let., Vol. 34, No. 2, 2013
- [11] J. A. Baldwin, "Properties of a Ferromagnetic Powder in a Nonmagnetic Matrix", J. Appl. Phys., Vol. 39, 1968
- [12] http://www.coilcraft.com/pdfs/pfl1005.pdf
- [13] J. Liljeholm, "3D MEMS wafer level packaging exemplified by RF characterized TSVs and reliability with failure analysis", Proc. IWLPC 2014, San Jose, CA, USA

### Seite 17

